



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN  
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 873397  
(51) Kv.lk.<sup>4</sup>/Int.cl.<sup>4</sup> G 03 F 7/02  
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 05.08.87  
(23) Alkuperäpäivä-Löpdag  
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 05.08.87  
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan GB86/00743  
(30) Etuoikeus-Prioritet 05.12.85 GB 8529958

(71) Hakija/Sökande: *Vickers PLC*, Vickers House, Millbank Tower, Millbank, London, Iso-Britannia

(72) Keksijä/Uppfinnare: Cooper, Graham Philip

(74) Asiamies/Ombud: Forssen & Salomaa

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Säteilyherkkiin laitteisiin tarkoitettuja tai niihin liittyviä parannuksia. Förbättringar till eller som hänför sig till strålningskänsliga anordningar.

(57) Tiivistelmä

Säteilyherkkä laite, joka käsittää säteilyherkkää kerrosta kantavan substraatin, päällystetään epäyhtenäisellä peitekerroksella, joka peitekerros on valoherkempää kuin säteilyherkkä kerros. Peitekerros muodostetaan suihkuttamalla ja se auttaa parantamaan tyhjövetoa laitteen kuvantapaisen valotuksen aikana ilman, että tämä vaikuttaisi vahingollisesti laitteen valotus- ja kehitysominaisuuksiin.

(57) Sammandrag

En strålningskänslig anordning, som omfattar ett substrat som uppbär ett strålningskänsligt skikt, beläggs med ett oenhetligt täcksikt, vilket täcksikt är ljuskänsligare än det strålningskänsliga skiktet. Täcksiktet bildas genom sprutning och det hjälper till att förbättra vakuumdragning under bildliknande exponering av anordningen utan att detta inverkar menligt på anordningens exponerings- och framkallningsegenskaper.